

ウエハケース内ウエハの有機汚染評価

製造プロセスにおける有機汚染の原因や総量を評価できます

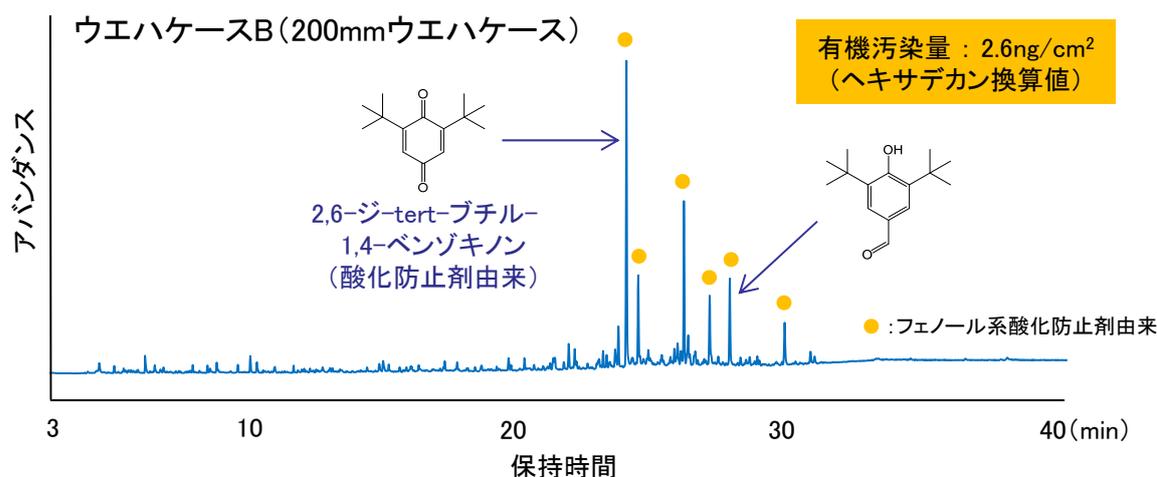
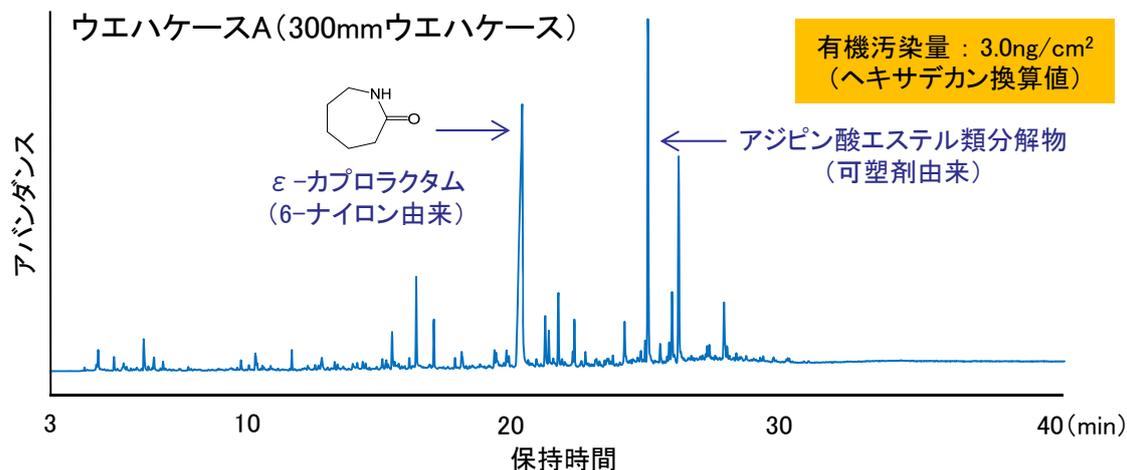
測定法 : GC/MS
 製品分野 : LSI・メモリ・パワーデバイス
 分析目的 : 組成評価・同定・微量濃度評価

概要

ウエハ表面に有機物が吸着することで、ゲート酸化膜の耐圧劣化など様々な問題が発生することが知られています。そのため、半導体デバイスの微細化・高集積化が進むにつれて、無機物だけでなく微量の有機物についても汚染量を把握することが重要になってきています。ここでは、2種類のウエハケースにSiウエハを保管し、ウエハ表面全体に付着した有機汚染成分をウエハアナライザーでそれぞれ濃縮し、GC/MSで評価した事例を紹介します。

データ

■ウエハ搬送用ケース内の有機汚染評価



ケースAは6-ナイロンや可塑剤由来と考えられる汚染、
 ケースBはフェノール系酸化防止剤由来の汚染が確認されました。

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
 URL : <https://www.mst.or.jp/>